

主旨： 半導體微機電系統基礎技術實作研習

承辦單位： 崑山科技大學機械工程系

協辦單位： 財團法人國家實驗研究院奈米元件實驗室

經費來源： 九十三年度教育部辦理技專院校提升教師實成

長專案計畫--崑山科技大學教師半導體微機

電系統基礎技術實作及網路虛擬實境教材製

作實務能力提升計畫

說明：

一、本課程對象資格及名額如下：

崑山科技大學各科系教師。限額 20 名。

二、上課地點及日期：

1. 半導體微機電系統基礎課程研習：

時間： 8 月 2 日(一) ~ 8 月 6 日(五)

地點： 崑山科技大學工學館 5F

2. 半導體微機電系統技術實作研習：

時間： 8 月 10 日(二) ~ 8 月 11 日(三)

地點： 台南 NDL 南科辦公室(台南科學園區南科三路 27 號 1 樓)

三、報名：

(一)報名方式：一律採 E-mail 報名

E-mail: g920h026@stug92.ksut.edu.tw。

(二)報名日期：即日起至 93 年 7 月 15 日止，額滿提前截止。

四、連絡方式：

電話：(06)205-3522 機械系 洪興林 老師

E-mail: hortl@mail.ksut.edu.tw

五、學員費用：全免

附表：

一、 半導體微機電系統基礎課程研習：限額 20 名。

時間： 8 月 2 日(一) ~ 8 月 6 日(五)

地點： 崑山科技大學工學館 5F

師資： NDL 研究員

課程表：

上課日期	8/2 星期一	8/3 星期二	8/4 星期三	8/5 星期四	8/6 星期五
09:00-12:00	積體電路與 平面顯示器 簡介	化學氣相 與物理氣 相沉積技 術	乾式與濕 式蝕刻	TFT-LCD	電性量測 與材料量 測
	潔淨技術				
13:30-16:30	廠務技術	微影技術	氧化擴散	微機電製程 整合	封裝
					結業

二、 半導體微機電系統技術實作研習。(限額 20 名)

時間： 8 月 10 日(二) ~ 8 月 11 日(三)

地點： 台南 NDL 南科辦公室。台南科學園區南科三路 27 號 1 樓。

師資： NDL 研究員及工程師

課程內容：

參加本次積體電路見習的 20 位學員，在二天的見實課程中將包含四個積體電路製造主要模組，分別為晶圓潔淨技術模組(Wafer Cleaning Technology)、薄膜沉積技術模組 (Thin Film Technology)、微影技術模組 (Lithography Technology)、及蝕刻技術模組 (Etching Technology)。因此見習的 20 位學員預計分成 4 組，由 4 位 NDL 助理研究員負責詳細介紹各機台模組之原理與操作。